



弧源-多离子束材料表面改性技术

申请（专利）号: CN92100416.8

发明（设计）人: 陈宝清

摘要: 弧源—多离子束材料表面改性技术是在具有离子束注入源、离子束溅射源、弧源及工件负高压电源等装置中实现的。处理工件表面改性层有较宽过渡层，附着性好，沉积速率高；在工作表面可形成单层或多层氮化物、碳化物、氮—碳化物等改性层；一机可以完成离子镀、离子束混合、离子注入。可用于各类刀具、模具、轴承、牙轮钻、手表、灯具等零件；本技术无公害，有广泛应用前景。

主权项: 一种弧源—多离子束材料表面改性技术是在由真空室（1）、弧源（2）、离子束注入源（9）、离子束溅射源（6）、工作台（3）、工件负高压电源（4）、靶台（8）等组成的设备装置中实现的，其技术主要特征是：以弧源（2）、离子束注入源（9）、离子束溅射源（6）、工件负高压电源（4）作为弧源—多离子束材料表面改性技术系统的供电装置，产生金属原子束及气体离子束；工件（5）加上负高压电场吸引气体离子束。

关闭

处长信箱 | 科技处办公室 | 综合科 | 开发部 | 科研科 | 技术转移中心 | 专利中心

Copyright @ 2000-2004 大连理工大学科技处 联系我们 联系管理员: 86961228

地址: 大连市凌工路2号 大连理工大学主楼 邮编: 116023 FAX: 84691725